

Vacuum Gauge Calibration System(VGCS) 개발과 Multi Purpose PVD System(DAON) 소개

남승재, 이금옥, 윤청식, 홍승수¹

(주)브이티에스, ¹한국표준과학연구원

본 사는 다년간의 진공 기술을 기반으로 한 연구개발용 장비제작 경험을 바탕으로 사용자 중심의 장비를 개발해 왔다. 금번 소개할 Vacuum Gauge Calibration System(VGCS)은 저진공에서 고진공영역까지 부피 팽창법을 이용해 In-situ로 진공 게이지의 직접 및 비교 교정이 가능한 장치이다 또한 VGCS는 산업체 보급 및 표준 유지를 위해 개발 되어진 장비 이다.

Multi purpose PVD System (이하 DAON)개발의 목적은 폴리머 박막과 금속 박막의 물리/화학적 특성제어를 위해 연구자 중심적 다기능 시스템 제어 소프트웨어와 증착율 및 진공도 측정이 가능한 모듈의 개발과 자사에서 개발한 E-beam 및 Thermal source, Sputtering source 등 다양한 증착 모듈과의 적용을 위함이다.

DAON은 최적화된 연구자 중심의 제어 프로그램과 증착 측정 모듈의 자동화를 통해 연구 소재의 재현성을 높이고, 연구 생산성을 높여 국내 외 연구용 장비 시장에 보급 중이다.